

バイオガスおよびオフガスのバイオメタン向け ヴァイサラ MGP260シリーズ

環境に配慮しながら 収益性を確保する。



バイオガス精製からバイオメタンへのアップグレードまで、ヴァイサラはお客様のサービス提供を支援します。バイオガスの生産量と品質の向上を目指すお客様にも、バイオガスのバイオメタンへのアップグレードによって収益性と環境保護を両立しようとするお客様にも、ヴァイサラはその目標を実現する次世代の解決策を提供します。

現場取り付け可能で堅牢な 光学製品

MGP261とMGP262は、バイオガスパイプ内で直接メタンと二酸化炭素を計測できる防爆認定機器です。メリットとして、コンパクトで可動部品がなく、メンテナンスの必要性が大幅に低減していることが挙げられます。

循環型経済の実現を支援

長い道のりを経て環境にやさしい経済が実現されようとしています。MGP261とMGP262を使用すると、バイオガス精製とバイオメタンへのアップグレードの両方の非効率性を解消できます。情報の把握は推測に勝るため、当社のお客様がバイオガスプロセス全体を常時制御し、効率が上がるように支援します。



ヴァイサラ MGP260シリーズ

- コンパクト
- ゾーン0/1での防爆認定取得
- プロセスラインに直接現場取り付け可能
- 特許取得済みのCARBOCAP® IRテクノロジーにより、精度が向上し、校正の必要性が最小限に



MGP261 – バイオガスプラントを最適化

グローバルクオリティイノベーション賞の受賞歴もあるMGP261は、生産量というバイオガス精製における最大の問題を解決します。MGP261は、産業廃棄物や都市廃棄物の嫌気性消化、廃水処理およびランドフィルガスのモニタリングを改善し、コージェネレーション (CHP) エンジンを守るのに役立ちます。

堅牢でコンパクトな3-in-1のメタン、二酸化炭素、水蒸気プローブは、信頼性の高い計測を常時提供するため、生産量を向上させることができます。MGP261でバイオガスプラントの最適化を目指しましょう。

MGP262 – 収益の減少を阻止

オフガスのメタンと高濃度CO₂向けのMGP262を使用すれば、非効率を排除して必要な方法でアップグレードユニットを稼働させることができます。

一定量のメタンが常に漏出している現状を考慮し、MGP262は開発されました。本製品は、高コストで有害なメタンスリップを最小限に抑えるためのワンストップツールです。常時計測を行うMGP262によってプロセスを制御することで、可能な限り高品質なバイオメタンの生産に注力できるようになります。

	 ヴァイサラ MGP261 メタン、二酸化炭素、 水蒸気マルチガスプローブ	 ヴァイサラ MGP262 メタンおよび二酸化炭素 マルチガスプローブ
主な用途	バイオガス原料のモニタリング	バイオメタンオフガスのモニタリング
取り付けの種類	現場	
センサ	CARBOCAP®	
メタン (CH ₄) 計測範囲	0~100vol-%	0~5vol-%
二酸化炭素 (CO ₂) 計測範囲	0~100vol-%	0~100vol-%
水蒸気 (H ₂ O) 計測範囲	0~25vol-%、 -10~+60°C (露点)	該当なし
CH ₄ 精度 (+25°Cおよび1,013mbarにおいて) ¹⁾	0~40vol-% : ±2vol-% 40~70vol-% : ±1vol-% 70~100vol-% : ±2vol-%	0~2vol-% : ±0.1vol-% CH ₄ 2~5vol-% : 読み値の±5%
CO ₂ 精度 (+25°Cおよび1,013mbarにおいて) ¹⁾	0~30vol-% : ±2vol-% 30~50vol-% : ±1vol-% 50~100vol-% : ±2vol-%	90~100vol-% : ±1vol-% 0~90vol-% : ±2vol-%
H ₂ O 精度 (+25°Cおよび1,013mbarにおいて) ¹⁾	0~25vol-% : ±0.5vol-%	該当なし
繰り返し性 : CH ₄	±0.5vol-% (60vol-%の場合)	< ±0.1vol-% (1% CH ₄ の場合)
繰り返し性 : CO ₂	±0.3vol-% (40vol-%の場合)	±0.4vol-% (95vol-%の場合)
繰り返し性 : H ₂ O	±0.1vol-% (10vol-%の場合)	該当なし

¹⁾ 非直線性、校正の不確かさ、繰り返し性を含む。
他のガスとの相互干渉を除き、温度と圧力は補正済み。

VAISALA

詳細は以下よりお問い合わせください。
www.vaisala.com/ja/contactus

www.vaisala.jp

Ref. B212439JA-A ©Vaisala 2022
 本文書は著作権保護の対象となっており、全ての著作権はヴァイサラと関連会社によって保有されています。無断複写・転載を禁じます。本文書に掲載されているすべてのロゴおよび製品名は、ヴァイサラまたは関連会社の商標です。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用 (複製、送信、頒布、保管等を含む) することは、事前に当社の文書による許諾がない限り、禁止します。技術的仕様を含め、全ての仕様は予告なく変更されることがあります。